【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成17年1月13日(2005.1.13)

【公表番号】特表2000-508973(P2000-508973A)
【公表日】平成12年7月18日(2000.7.18)
【出願番号】特願平9-538976
【国際特許分類第７版】
　Ｂ０５Ｃ　5/00
【ＦＩ】
　Ｂ０５Ｃ　5/00　１０３

【手続補正書】
【提出日】平成16年4月19日(2004.4.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】

手続補正書

平成１６年　４月１９日

特許庁長官殿

１．　事件の表示

平成０９年特許願第５３８９７６号

２．　補正をする者

氏名（名称）　ミネソタ・マイニング・アンド・
マニュファクチャリング・カンパニー

３．　代理人

住所　〒540-0001
大阪府大阪市中央区城見１丁目３番７号　ＩＭＰビル
青山特許事務所
電話 06-6949-1261　　ＦＡＸ 06-6949-0361

氏名　弁理士　(6214) 青山　葆

４．　補正対象書類名　請求の範囲

特許庁
16.4.21
出願支援課
石塚

５．　補正対象項目名　請求の範囲

６．　補正の内容
別紙のとおり。

請求の範囲

１．コーティング装置の外枠であって、該コーティング装置は膜の形態で上に液体を流すのに好適なコーター面を具備するタイプの装置であり、該膜は該コーティング装置と１つ以上のエッジ接触面で接触する１つ以上のエッジを有し、該１つ以上のエッジ接触面の上方に半密閉空間を画成する外枠であって、上記コーター面の実質部の視認および同部へのアクセスが可能な形状を有する外枠。

２．コーティング装置と外枠とを具備するコーター組立体であって、該コーティング装置は膜の形態で上に液体を流すのに好適なコーター面を具備するタイプの装置であり、該膜は該コーティング装置と１つ以上のエッジ接触面で接触する１つ以上のエッジを有し、該外枠は該１つ以上のエッジ接触面の上方に半密閉空間を画成し、該外枠は上記コーター面の実質部の視認および同部へのアクセスが可能な形状を有する、コーター組立体。

３．支持体に液体を塗布する方法であって、

コーティング装置と外枠とを具備するコーター組立体を供するステップと、

溶剤成分を含み、コーティング装置の表面上に接触して流れ、該コーター表面との間の界面に１つ以上の静止接触線をなす塗料液を供するステップと、

該コーター組立体を使用して該支持体の上に液体を塗布するステップとを含み、

該外枠は該静止接触線上方に半密閉空間を画成し、該外枠は、該コーティング装置上を該塗料液が流れているときに該塗料液の実質部に対する視認およびアクセスが可能な形状を有する方法。